

# Sistema Di Pulizia A Vapore Acido In Ptfе Ad Alta Purezza Per La Decontaminazione Di Articoli Da Laboratorio Per Analisi In Tracce Con Tecnologia A Riflusso Chiusa Antigoccia E Capacità Multi-Posizione Personalizzabile

Numero articolo: PL-CP113



## introduzione

Ottimizzate i flussi di lavoro per l'analisi in tracce con questo sistema di pulizia a vapore acido in PTFE ad alta purezza. Dotato di un design a circuito chiuso antigoccia per un notevole risparmio di acido e una decontaminazione superiore, questa unità personalizzabile garantisce livelli di fondo ultra-bassi per applicazioni di laboratorio sensibili come ICP-MS e ICP-OES.

## Ulteriori informazioni

Applicazione	Descrizione	Vantaggio Principale
Analisi di Metalli in Tracce	Decontaminazione di recipienti per digestione in TFM e PFA utilizzati nella preparazione di campioni per ICP-MS e ICP-OES.	Raggiunge livelli di fondo ultra-bassi per la rilevazione a PPT e PPB.
Produzione di Semiconduttori	Pulizia di portawafers in PFA e componenti per la gestione dei fluidi per rimuovere contaminanti superficiali in tracce.	Previene la contaminazione metallica nei processi di fabbricazione ad alta purezza.
Ricerca Geochimica	Pulizia profonda di crogioli in Teflon e tubi di digestione utilizzati per la dissoluzione di minerali e l'analisi isotopica.	Garantisce un'alta accuratezza nelle misurazioni isotopiche e mineralogiche sensibili.
Monitoraggio Ambientale	Lavaggio automatizzato di grandi lotti di contenitori per campioni di suolo e acqua prima dei test per metalli pesanti.	Aumenta il rendimento del laboratorio mantenendo un rigoroso controllo di qualità.
Clinica & Farmaceutica	Sanificazione di flaconi e pipette in PFA utilizzati per studi sensibili su biologia e metabolismo dei farmaci.	Elimina la contaminazione incrociata tra lotti di campioni medici sensibili.
Ingegneria Nucleare	Decontaminazione di articoli da laboratorio specializzati in fluoropolimero utilizzati nell'analisi di materiali radioattivi e corrosivi.	Fornisce un ambiente sicuro e chiuso per la manipolazione di reagenti pericolosi.

Parametro	Specifiche per PL-CP113
Numero Articolo Prodotto	PL-CP113
Materiale di Costruzione Primario	PTFE / PFA Vergine ad Alta Purezza
Meccanismo di Pulizia	Riflusso Vapore Acido / Pulizia a Vapore a Sub-Ebollizione
Reagenti Compatibili	HNO <sub>3</sub> , HCl, HF e altri acidi ad alta purezza
Capacità di Processo	26 posizioni (Standard) / Completamente Personalizzabile
Metodo di Tenuta	Tenuta Antigoccia Filettata e Guarnita
Resistenza alla Temperatura	Funzionamento continuo fino a 200°C (Limite del materiale)

Applicazione	Descrizione	Vantaggio Principale
Parametro	Specifiche per PL-CP113	
Opzioni di Personalizzazione	Dimensioni della camera, geometria del rack e diametri dei tubi	
Sistema di Controllo	Compatibile con controllori di temperatura PID esterni	
Processo di Produzione	Fabbricazione CNC di precisione end-to-end	